Si ドープ In_{0.8}Ga_{0.2}As/Al_{0.5}Ga_{0.5}As/AlAs_{0.56}Sb_{0.44}結合量子井戸におけるスピン緩和

Spin relaxation in Si doped In_{0.8}Ga_{0.2}As/Al_{0.5}Ga_{0.5}As/AlAs_{0.56}Sb_{0.44} coupled double quantum wells

^O石川 友樹¹, 牛頭 信一郎², 物集 照夫², 大木 俊介¹, 山田 築¹, 亀崎 拓也¹, 竹内 淳¹ 早大先進理工¹, 産業技術総合研究所²

^oT. Ishikawa¹, S. Gozu², T. Mozume², S. Ohki¹, K. Yamada¹, T. Kamezaki¹ and A. Tackeuchi¹

Waseda Univ.¹, AIST²

E-mail address: asdf8974@akane.waseda.jp

InGaAs/AlAsSb 結合量子井戸(CDQWs)は、1.7 eV の 大きな伝導帯バンドオフセット持つため通信波長帯 である波長 1.55 μ m でのサブバンド間遷移を利用した 全光型スイッチングデバイスへの応用が期待されて いる^{1.2}。我々はこれまでに井戸層幅 2.8 nm、バリア 層幅 2 nm、Al_{0.5}Ga_{0.5}As 中間層幅が 3 原子層のノンド ープ In_{0.8}Ga_{0.2}As/Al_{0.5}Ga_{0.5}As/AlAs_{0.56}Sb_{0.44} 結合量子井 戸における電子のスピン緩和を測定し、温度 10 Kに おいて 6.31 ps と 249 ps の 2 成分のスピン緩和時間を 観測した³。本研究では井戸層へ Si をドープした In_{0.8}Ga_{0.2}As/Al_{0.5}Ga_{0.5}As/AlAs_{0.56}Sb_{0.44} 結合量子井戸の スピン緩和時間を円偏光時間分解ポンププローブ反 射計測を用いて調べた。

サンプルは半絶縁性 InP 基板上に Si を 1×10¹⁹ cm⁻³ ドープした In_{0.8}Ga_{0.2}As 井戸層 2.9 nm、AlAs_{0.56}Sb_{0.44} バリア層 2 nm、井戸層間に Al_{0.5}Ga_{0.5}As 中間層を 2 原 子層、これらを 60 周期 Molecular Beam Epitaxy 法によ り積層した結合量子井戸 (Fig. 1) である。また井戸 層とバリア層の間に Sb の偏析を抑えるため AlAs を 2 原子層挿入している⁴。中間層が Al_{0.5}Ga_{0.5}As である理 由は、サブバンド間 (el-e4) とバンド間 (hh1-el) の 光吸収波長を共に通信波長帯の 1.55 μ m に近づける ためである⁵。電子のスピン緩和の観測には円偏光時 間分解ポンププローブ反射計測を用いた⁶。励起光源 にはフェムト秒超短パルスチタンサファイアレーザ ーを使用し、光パラメトリック発振器を用いて赤外光 パルスへと変換した。本実験系における時間分解能は パルスの時間幅に依存し 200 fs である。

Figure 2 (a)に温度 10 K、励起光強度 40 mW におけ るポンププローブ反射計測の結果を示す。Γはポンプ 光とプローブ光が同一円偏光の場合、Γは逆円偏光の 場合の結果である。また Fig.2 (b)に(a)から求めたスピ ン偏極率の時間変化を示す。単一指数関数近似により 求めたスピン緩和時間は 32.4 ps であった。以前報告 したノンドープ In_{0.8}Ga_{0.2}As/Al_{0.5}Ga_{0.5}As/AlAs_{0.56}Sb_{0.44} 結合量子井戸のスピン緩和は二重指数関数で近似で き緩和成分は 2 つだったが、本サンプルでは単一指数 関数近似により 1 つの緩和成分のみが見られた。

10 K において本サンプルのスピン緩和時間は励起 光強度を 40 mW, 50 mW, 60 mW と変化させると緩や かに速くなった。よって低温でキャリア濃度依存性を 持つ緩和メカニズムである Bir-Aronov-Pikus 効果が 10 K で寄与していると考えられる 7。



Fig. 1 Sample structure and energy band diagram of InGaAs/AlAsSb CDQWs.



Fig. 2 Time evolutions of (a) spin-dependent reflection intensity and (b) spin polarization in InGaAs/AlAsSb CDQWs at 10 K.

- ¹ R. Akimoto et al., App. Phys. Lett. **91**, 221115 (2007).
- ² T. Mozume et al., J. Vac. Sci. Technol. B **28**, C3C25 (2010).
- ³石川 他, 第 63 回応用物理学会春季学術講演会 20p-S223-8 (2016).
- ⁴ J. Kasai et al., J. Cryst. Growth. **278**, 183 (2005).
- ⁵ T. Mozume et al., Phys. Stat. Sol. C **9**, 334-337 (2012).
- ⁶ A. Tackeuchi et al., Appl. Phys. Lett. **56**, 2213 (1990).
- ⁷ G. L. Bir et al., Sov. Phys. JETP, **42**, 705 (1976).